

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年6月12日(12.06.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/121182 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/66 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/041592

(22) 国際出願日: 2024年11月25日(25.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-207126 2023年12月7日(07.12.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).

(72) 発明者: 田代 晃一郎 (TASHIRO, Koichiro); 〒4078511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 (JP). 小林 将人(KOBAYASHI, Masahito); 〒4078511 山

梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 (JP).

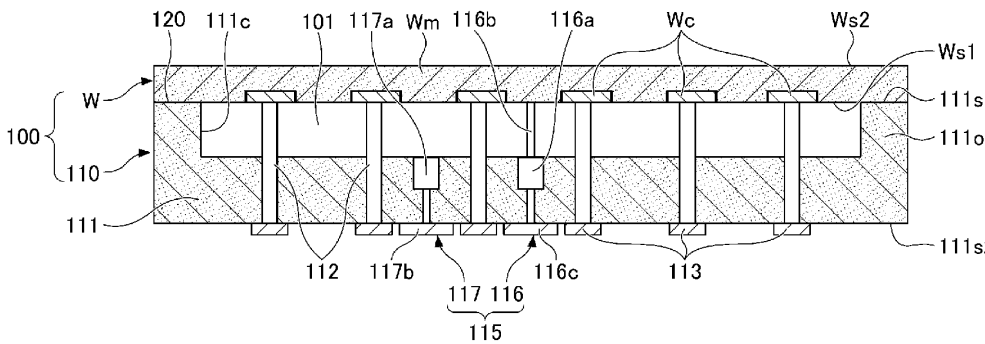
(74) 代理人: 弁理士法人 I T O H (ITO H PATENT ATTORNEY CORPORATION); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル16階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: INSPECTION SYSTEM, INSPECTION METHOD, AND SHELL STRUCTURE

(54) 発明の名称: 検査システム、検査方法、およびシェル構造体

[図1B]



(57) Abstract: This inspection system includes: a joining device that joins a substrate and a jig in a state of contact and electrical continuity between a conduction portion of the substrate and a contacting portion of the jig to form a shell structure exposing electrodes of the jig; a conveyance module which is connected to the joining device and which conveys the shell structure formed by the joining device; a determination unit that determines whether the joined state of the shell structure formed by the joining device is normal or abnormal; and an inspection device which is connected to the conveyance module and which inspects the substrate via the electrodes of the jig of the shell structure that is determined to be normal by the determination unit.

[続葉有]

WO 2025/121182 A1

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 検査システムは、基板の導通部と治具のコンタクト部とを接触および導通させた状態で当該基板および当該治具を接合し、前記治具の電極を露出したシェル構造体を形成する接合装置と、前記接合装置に接続され、前記接合装置で形成された前記シェル構造体を搬送する搬送モジュールと、前記接合装置により形成された前記シェル構造体の接合状態の正常または異常を判定する判定部と、前記搬送モジュールに接続され、前記判定部により正常と判定された前記シェル構造体の前記治具の電極を介して前記基板を検査する検査装置と、を有する。